

## 主要特点

- 库伦型吸盘或梯度力吸盘
- 支持双电极、多电极、叉指电极等设计
- 适用于 $10^{-5}$ Pa及以下超高真空环境
- 静电吸附力大
- 吸附面全局面型精度高
- 吸附面表面图形可定制
- 适用于无磁环境
- 适吸附对象包括晶圆, 蓝宝石、玻璃等介电材料

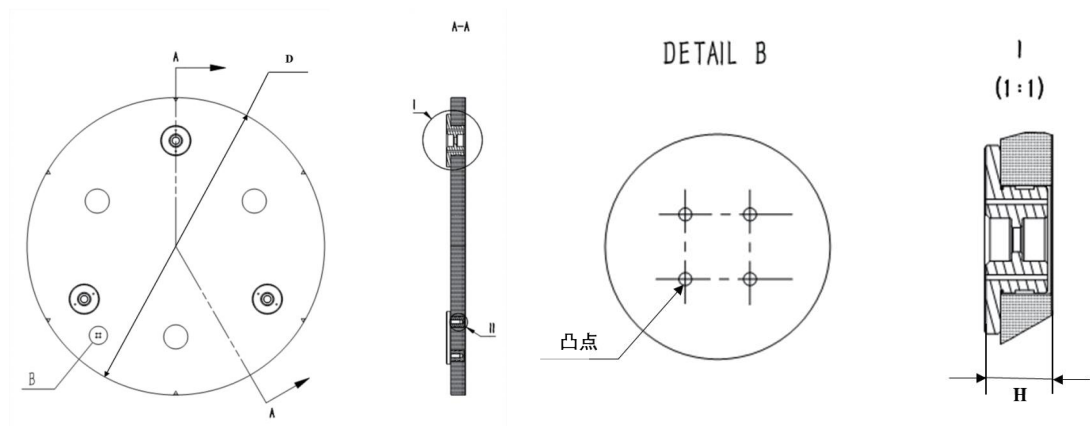
## 性能简介

静电吸盘(ESC)是半导体工艺中的硅片夹持工具。ESC以静电吸附为基本原理在施加外部高压后,通过静电吸盘对硅片的库仑吸附力或J-R吸附力来固定硅片的。

## 主要应用

- 晶圆量测: EBI, CD-SEM, Review-SEM
- 晶圆制造: 电子束光刻 (EBL)
- 薄膜沉积 (CVD、PVD等)
- 离子注入等

## 机械尺寸图



通用外形尺寸, 单位:mm

## 技术参数

	6inch ESC	8inch ESC	12inch ESC	单位
原理类型/Electrostatic type	库伦型或梯度力	库伦型或梯度力	库伦型或梯度力	
电极数量/Number of electrodes	双电极	双电极	双电极	
<b>精度/Accuracy</b>				
全局平面度/Global flatness	<1	<1	<2	μm
平行度/Parallelism	<5	<5	<5	μm
<b>电气性能/Electrical properties</b>				
标准吸附电压/Standard clamping voltage	1000	1000	1000	V
漏电流/Leakage current	<5	<5	<5	nA
<b>性能参数/Performance parameter</b>				
吸附力/Clamping force	≥10(库伦型)	≥16(库伦型)	≥40(库伦型)	N
<b>外观尺寸/Dimensions</b>				
直径/Diameter	144	194	294	mm
厚度/Thickness	12.6	12.6	12.6	mm

\*电极数量、平面度指标、外形尺寸和相关结构均可定制化设计